(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年5 月26 日 (26.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/048332 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 21/205

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016905

(22) 国際出願日:

2004年11月8日(08.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-382116

2003年11月12日(12.11.2003) Л

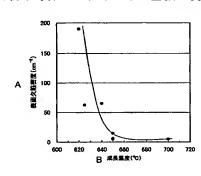
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友化学株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1048260 東京都中央区新川二丁目27番1号 Tokyo (JP). 高田 朋幸 (TAKADA, Tomoyuki) [JP/JP]; 〒3050045 茨城県つくば市梅園2-13-1-4-102 Ibaraki (JP).

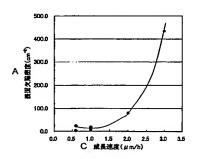
(72) 発明者; および

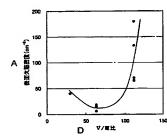
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小廣健司 (KO-HIRO, Kenji) [JP/JP]; 〒3050045 茨城県つくば市梅園 2-13-1-4-201 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 榎本 雅之, 外(ENOMOTO, Masayuki et al.); 〒5418550 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5番 3 3号 住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

- (54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING COMPOUND SEMICONDUCTOR EPITAXIAL SUBSTRATE
- (54) 発明の名称: 化合物半導体エピタキシャル基板の製造方法







- A SURFACE DEFECT DENSITY (cm⁻²) B GROWTH TEMPERATURE (°C)
- A SURFACE DEFECT DENSITY (cm⁻²)
- C GROWTH RATE (µM/h)
- A SURFACE DEFECT DENSITY (cm⁻²)
- D V/III RATIO

(57) Abstract: Disclosed is a method for manufacturing a compound semiconductor epitaxial substrate with few hollow defects. The method for manufacturing a compound semiconductor epitaxial substrate comprises a step for epitaxially growing an InGaAs layer on an InP single crystal substrate or on a layer lattice-matched to the InP single crystal substrate at a V/III ratio of 10-100, a growth temperature of 630-700°C and a growth rate of 0.6-2 μ m/h.

(57)要約: 本発明は、凹状欠陥の少ない化合物半導体エピタキシャル基板の製造方法を提供する。化合物半導体エピタキシャル基板の製造方法は、InP単結晶基板の上、またはInP単結晶基板と格子整合する層の上に、エピタキシャル成長により、V/Ⅲ比:10~100、成長温度:630℃~700℃、成長速度:0.6μm/h~ 2μm/hの条件下、InGaAs層を形成する工程を含む。





(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書